

# 上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼离子源 KDC 10

产品名称	上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼离子源 KDC 10
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:KDC 10 产地:美国
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

KRI 考夫曼 [离子源](#) KDC 10上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼 [离子源](#) KDC 10:  
考夫曼型[离子源](#) Gridded 系列\*小型号的 [离子源](#). 适用于集成在小型的真空设备中, 例如预清洗, 离子溅射, 离子蚀刻. 在<1000eV 低能量, 通 Ar 氩气时离子蚀刻的能力显著提高.KDC 10 [离子源](#)低损伤, 宽束设计, 低成本等优点广泛应用在显微镜领域, 标准配置下 KDC 10 离子能量范围 100 至 1200ev, 离子电流可以超过 10mA. KRI 考夫曼 [离子源](#) KDC 10 技术参数

型号	KDC 10
供电	DC magnetic confinement
- 阴极灯丝	1
- 阳极电压	0-100V DC
- 栅极直径	1cm
中和器	灯丝
电源控制	KSC 1202
配置	-
- 阴极中和器	Filament, Sidewinder Filament 或LFN 1000
- 架构	移动或快速法兰
- 高度	4.5'
- 直径	1.52'
- 离子束	集中平行散设
- 加工材料	金属电介质半导体
- 工艺气体	惰性活性混合
- 安装距离	2-12 "
- 自动控制	控制4种气体

KRI 考夫曼 [离子源](#) KDC 10 应用领域离子清洗, 显微镜抛光 IBP溅镀和蒸发镀膜  
PC辅助镀膜(光学镀膜) IBAD表面改性, 激活 SM离子溅射沉积和多层结构 IBSD离子蚀刻 IBE

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗女士